

在线监测



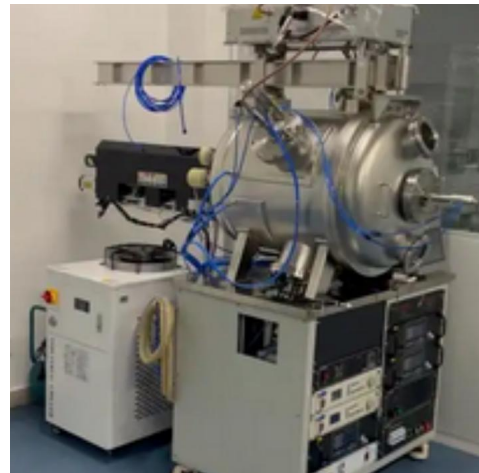
RGA残余气体分析仪 RGA

VSI RGA 凭借精准测量与智能分析，操作简便，实时同步数据。
广泛应用于半导体、科研及真空工艺，是保障真空系统洁净与高效运行的理想工具。

产品特点

- **4 寸高清触控**：操作快捷，显示清晰。
- **数据实时同步**：屏端与电脑无缝对接，即时存储。
- **SoC 智能核心**：融合精密测量与 AI 处理，精准可靠。

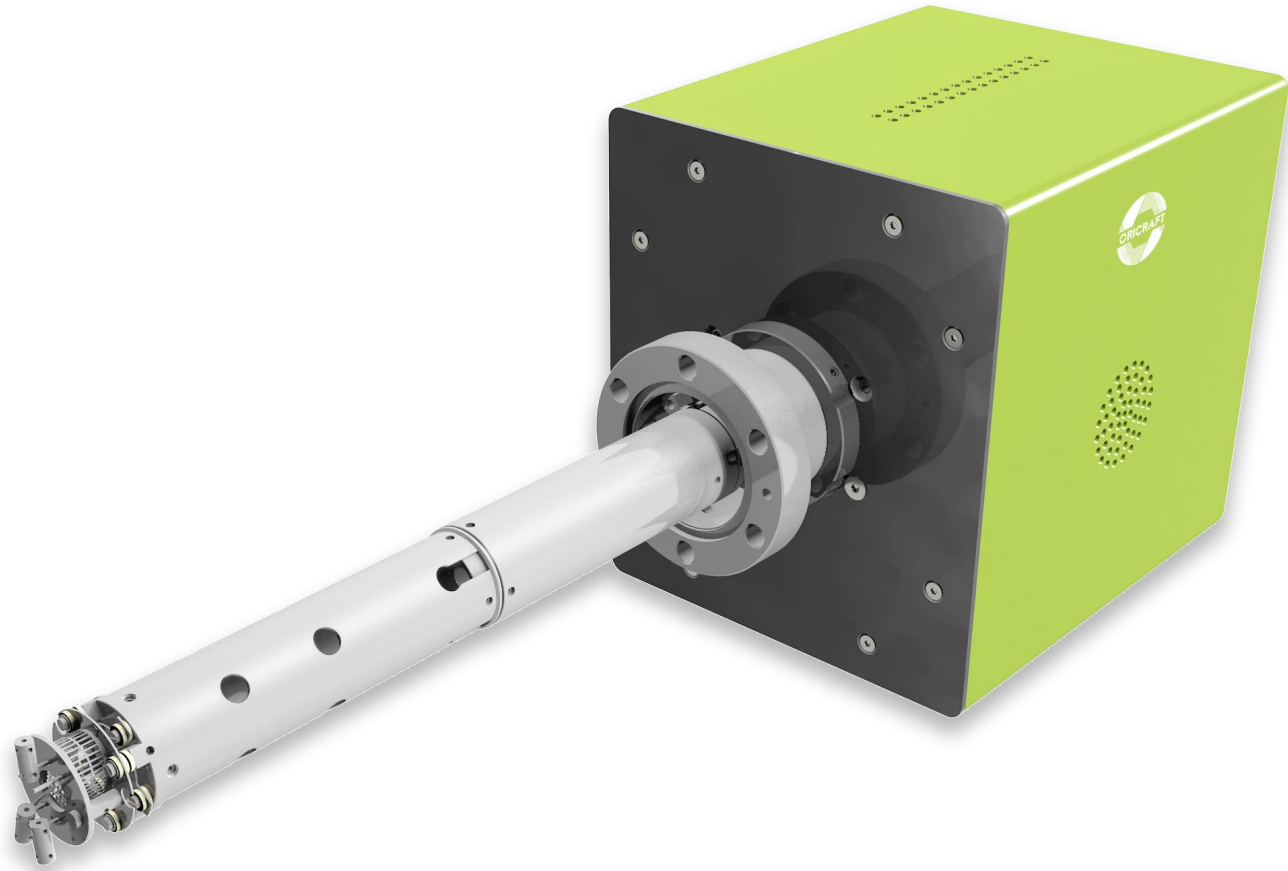
应用场景



• 真空镀膜质量管控



• 半导体工艺腔室监控



技术指标

参数事项	规格	参数事项	规格
压力	Maximum Operating Pressure: >5E-5 Torr	零爆干扰	<5ppm (2amu)
灯丝	W 或 Y2O3/Ir	最大采集速率	≤3ms per point
电子能量	0-110ev	四极杆射频频率	2.7MHz
发射电流	0 - 2mA	输入电源	24V DC, 3A
灯丝保护	具有开路、过流、总压保护	接口	RJ45 socket: 10/100M Base-T Ethernet 1路RS485 2路光耦输入 2路OC输出 2路模拟量输入(0-10V 16bit) 2路模拟量输出(0-10V 16bit)
最大传感器工作温度	FC:200℃ EM:150℃	显示屏控制功能	监控通道:4通道 监控报警:阈值可设 趋势线:4通道趋势走线
质量范围	1-100; 1-200;1-300	模拟输出	2路
探测器	FC、EM	数字输出	2路
灵敏度	FC: > 3E-4 A/Torr	报警输出	2路
最小可检分压	256ms dwell FC: <2E-12 Torr EM: <2E-14 Torr 4s dwell FC: <5E-13 Torr EM: <5E-15 Torr	法兰	CF35
分辨率	<1amu(10% peaks height)		
质量稳定性	<±0.1amu/8h		